

超高圧電子顕微鏡施設 機器利用料

2016年10月1日

I 1時間あたりの使用料

単位:円

	機器等名称	学 内 者	学 外 者		備 考
			非営利法人	営利法人	
1	反応科学超高圧走査透過電子顕微鏡システム JEM-1000K RS	2,600	3,500	10,300	☆
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	4,200	12,500	
2	高電圧用収差補正開発試験装置(収差補正電子顕微鏡) EM-10000BU	1,100	1,500	5,100	☆
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	1,800	6,200	
3	高分解能電子状態計測走査透過型電子顕微鏡システム(収差補正電子顕微鏡) JEM-ARM200F Cold	1,100	1,500	4,900	☆
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	1,800	5,900	
4	電子分光電子顕微鏡 JEM-2100M	900	1,300	5,200	☆
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	1,600	6,300	
5	高分解能透過型電子顕微鏡システム JEM-2100F/HK	700	1,000	4,200	☆
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	1,200	5,100	
6	走査電子顕微鏡 Quanta200FEG	500	800	4,200	☆
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	1,000	5,100	
7	環境実験用観察装置 MP-66100(走査電子顕微鏡) JSM-6610A	400	600	2,200	☆
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	700	2,700	
8	直交配置型高速加工観察分析装置(FIB-SEM) MI4000L	1,200	1,700	3,900	☆
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	2,100	4,700	
9	集束イオンビーム加工機(FIB) FB-2100	1,200	1,700	3,800	☆
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	2,100	4,600	
10	アルゴンイオン照射試料作成装置 クロスセクションポリッシャー	200	400	800	☆
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	500	1,000	
11	金属イオン照射試料作成装置 PIPS-II	200	400	700	☆
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	500	800	
12	クライオミクロトーム	200	400	600	☆
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	500	700	
13	電子ビーム制御装置(汎用電子顕微鏡) H-800	500	800	2,400	
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	1,000	2,900	
14	電界放出型電子顕微鏡 HF-2000	500	800	3,000	
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	1,000	3,600	
15	収差補正電子顕微鏡 JEM-2100F	1,600	2,200	6,900	
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	2,700	8,300	
16	高分解能分析電子顕微鏡 JEM-2010	700	1,000	6,400	
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	1,200	7,700	
17	三次元観察電子顕微鏡 TECNAI G2 Polara	1,200	1,700	9,300	
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	2,100	11,300	
18	イオンビーム試料作製装置(FIB) JEM-9320NT	800	1,100	2,500	
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	1,300	3,000	

☆の機器使用料は、文部科学省「ナノテクノロジープラットフォーム事業(微細構造解析PF)」の採択により軽減されております。
平成34年3月31日の事業終了後は、通常の料金設定となります。

- 1 基本使用料は機器利用1時間あたりの利用料です。
- 2 非公開使用料は、機器利用1時間あたりのオプション料金であり、基本料金に別途加算します。
- 3 利用料金には消費税が含まれています。

II 解析手数料(単位:円)

1時間当たり	6,500
--------	-------

III コンサルティング料(単位:円)

3時間未満	65,000
3時間以上～6時間未満	162,500
6時間以上～8時間	260,000